【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成18年4月20日(2006.4.20)

【公開番号】特開2000-281479(P2000-281479A)
【公開日】平成12年10月10日(2000.10.10)
【出願番号】特願平11-94695
【国際特許分類】
Ｃ３０Ｂ　15/20　　(2006.01)
Ｃ３０Ｂ　35/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ３０Ｂ　15/20
Ｃ３０Ｂ　35/00

【手続補正書】
【提出日】平成18年3月8日(2006.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】　引き上げられている単結晶インゴットから発せられる輻射熱を受けるフィンが、異方性熱伝導体の下部に取り付けられていることを特徴とする請求項１乃至３記載のチョクラルスキー法単結晶インゴット製造装置。